

Perancangan suatu clean room class 10.000 untuk suatu ruangan produksi pada industri semikonduktor

Candra Eka Putra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20342741&lokasi=lokal>

Abstrak

Dalini suatu industri smikonduktor, Clean Room memiliki pcranan yang sangat penting. Tingkat kebersihan udara yang dihasilkan dill am ruangan produksitersebut mempengaruhi terlmdap keberhasilan produk smikonduktor tersebut. Udara yang trkontmninasi oleh pmtikel-partikcl dan deb1.1 mengbasilkan produk yang gagal, sebaliknya 1.1dara yang bersih ukan menjadi salah satu faktor yang menjamin tingkat kberhasitan produk tersebut.

Ada beberapa hal yang haru!: dlkontrol di dalam sumu Clean Room Class 10.000, di antaranya :

1. Jumlah partikel di dalam Clean Room yang diperbolehkan tidak lebih dari t 0.000 partikel per fr'.
2. Temperatur udam di dahml ruangan dikondisikan pada suhu (23 ± 2) uC.
3. Kelcmbaban' datif(Rf-1) rmmgan dikondisikan pad:.. (55 ± 5) {}/o.

Untuk dapat mcni,iaga agar jmnlah partikel udara yang disuplai ke dalam ruangan yang digunakan untuk proses produksi. maku pcnggunaan HEPA (High Eflu.:iency Particulate 11ir) filtcl' sung_at dibutuhkan. Sedangkan untuk dapat menjaga kondisi udara di dalam ruangan produksi terseblll pada kondisi temperamr (23 ± 1) "C dan kelcmbabnn (55 ± 5) 'Ye, maka...